

光谱学

## 干涉成像光谱仪的EMC特性分析

薛利军<sup>1</sup>; 李自田<sup>2</sup>; 张晓春<sup>2</sup>; 刘学斌<sup>2</sup>; 王忠厚<sup>2</sup>; 皮海峰<sup>2</sup>; 李长乐<sup>2</sup>; <sup>2</sup>

中国科学院西安光学精密机械研究所, 西安 710119<sup>1</sup>

收稿日期 2006-3-21 修回日期 2006-10-30 网络版发布日期 2007-11-28 接受日期

**摘要** 进行了干涉成像光谱仪的EMC试验, 说明干涉成像光谱仪基本满足EMC试验大纲要求, 除其中个别项目如CE102电源线传导发射、RE102电场辐射发射部分频点超标外, 大纲规定的其它试验项目都合格. 采取滤波、隔离等措施后, CE102、RE102也合格, 表明干涉成像光谱仪可以在其工作的电磁环境中按设计要求运行, 并且不对该环境中其它设备构成不能承受的电磁干扰.

**关键词** [EMC](#) [干涉成像光谱仪](#) [LISN](#) [传导发射](#) [辐射发射](#)

**分类号** [TH744.1](#)

**通讯作者** 薛利军 [xlj@opt.ac.cn](mailto:xlj@opt.ac.cn)

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(651KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ [本刊中 包含“EMC”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [薛利军](#)
- [李自田](#)
- [张晓春](#)
- [刘学斌](#)
- [王忠厚](#)
- [皮海峰](#)
- [李长乐](#)
-